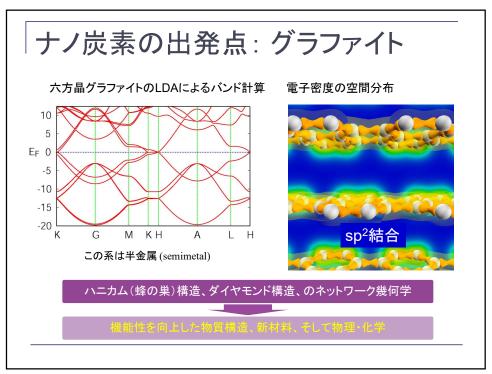
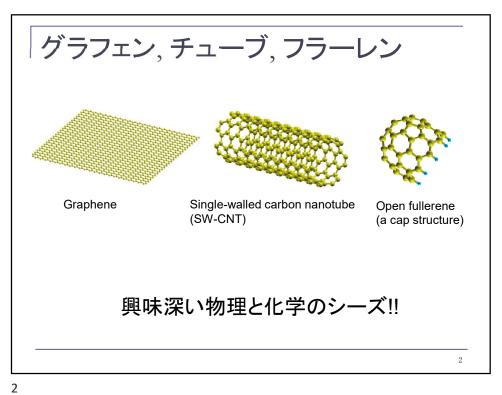
カーボン系ナノ機能材料

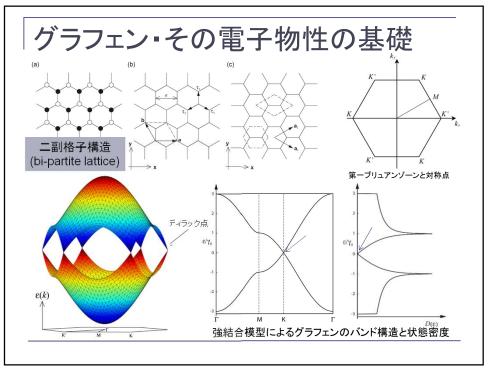
ナノマテリアル・ナノデバイスデザイン学

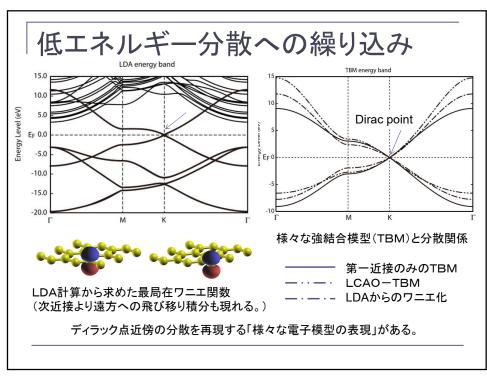
兵庫県立大学大学院理学研究科 教授 大阪大学大学院工学研究科・基礎工学研究科 招へい教授 草部 浩一

0









Δ

シミュレーションを生かす

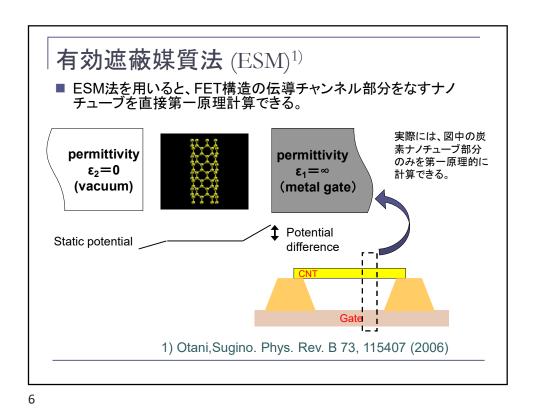
「ナノ炭素材料の表現」に適したシミュレーション(表現)技法を選択すると良い。

多様な有効ハミルトニアン

- 第一原理ハミルトニアン
- 密度汎関数法モデル(1体 描像版)
- 密度汎関数法モデル(2体 描像版)
- 強結合模型(1体描像版)
- 強結合模型(2体描像版)
- 有効質量近似(1体描像)
- 有効質量近似(2体描像)

多彩な境界条件

- 周期境界条件(Born-von-Karman)
 - 圧力下、応力下
 - 準安定点近傍
 - 原子数、電子数固定
- 有効媒質法(z方向版、動 径方向版)
 - 強電場下・非整数占有
- 定常電流存在下
- 物質環境場(表面・界面)



有効ポテンシャル ■ 静電ポテンシャルの形状は、ゲートバイアスによって明 らかに変化している。 以下のポテンシャルは、電極と平行な面上で平均した「電子に 対する有効ポテンシャル」を表記したもの。 0.05 -0.1 -0.25 -0.25 -0.35 -0.4 -0.45 -0.5 0.2 0.15 0.1 0.05 CNT -0.05 -0.15 -0.2 -0.25 -0.05 -0.3 -0.15 -0.6 L -15 -0.4 L -15 [a.u.] [a.u.] [a.u.] E= 0.288V/ Å E= 0 V/A E= 0.177 V/Å $(2.88 \times 0^{9} \text{V/m})$ $(1.77 \times 0^9 \text{ V/m})$ (0 V/m) 炭素ナノチューブ内部のポテンシャル変化はそれほど大きくない。: 遮蔽効果

(7,0) Tubeにおける化学ポテンシャルシフト (7,0)Tube 化学ポテンシャルシフト -3.00 は、Kohn-Shamバンド -3.50 ギャップと同じ値を示す。 これは一電子描像(平 -4.00 €_{-4.50} 均場近似)では当然そ うなるべき結果である。 <u>8</u> −5.00 265meV -5.50 -6.00 -6.50バンドギャップと多体励 起状態のより正確な評 -7.00 価には、GW近似やそ -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 Induced electron/Unit cell(28 Carbons) れを超える方法により 励起状態の精密評価 法を適用すると良い。

電界効果による荷電分布の変化

右側に極板が設置されている状況での(8,0)-ナノチューブ
の電荷分布を示す。
赤の面:電子密度が上昇した領域
青の面:電子密度が減少した領域

Gate voltage: 1.62V
(0.162V/Å)
0. 012% increase

電子密度が高少した領域

Gate voltage -1.08V
(0.108V/Å)
0. 012 % decrease

9

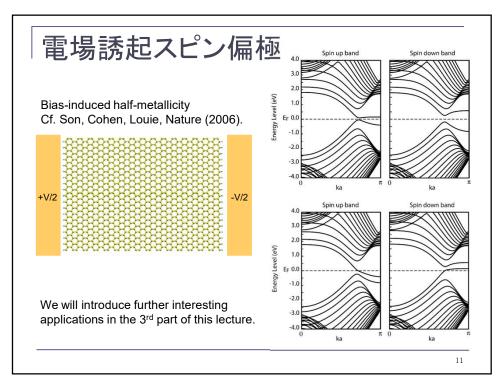
電界効果ドーピング評価結果

Case	Induced electrons / Carbon • V
Exp. (nanotube film)	7.28×10^{-4}
Calc. (7,0) tubes with 10Å spacing	1.2×10^{-3}
Calc. (7,0) tubes with 5.3Å spacing	8.2 × 10 ⁻⁴
Calc. a tube film (double layer)	3.6×10^{-5}
Calc. a tube film (double layer)	6.7×10^{-4}

- ・シミュレーションの定量的な一致がある。
- ・電界は、単一のチューブ層で静的スクリーンされる。
- ・電界効果ドーピングは最外層チューブに集中。

注: この計算は、無限長ナノチューブへの無限小ドーピングを見積もっている。 $\Delta = \lim_{N \to \infty} (E(N+1) - E(N))$ によるバンドギャップ評価に対応するので、Kohn-Sham ギャップの評価はLDAによるものになる。

10



グラフェンデバイス構造の理論設計

Ni NiFe arroy

Ni NiFe arroy





Graphene sheet スピン偏極電流デバイス

SiC, Diamond, or F M/I/SM/I/Mデバイス

Comments:

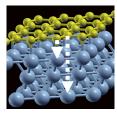
- 1. 電子デバイス化への鍵は、ディラック点における半導体型ギャップ形成。
- 2. 静的なギャップ形成は、基板選択して貼り付けることでも可能。
- 3. 動的なギャップ形成(ギャップ構造のスイッチング)も実は可能。

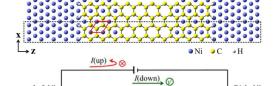
ギャップ形成の鍵は、「副格子サイトエネルギー対称性(カイラル対称性)の破れ」。

12

12

Graphene/Ni(111) の構造





Graphene/Ni

Spintronic transport via Ni/Gr/Ni junction H. Liu, et al., Nano. Res. Lett. 11 (2016) 456.

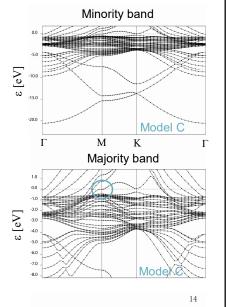
制御性(ディラック点のギャップ形成の磁場コントロール)、実現性(実施された実験)等の点で、さらに発展させる余地がある。
⇒ デバイス機能を与える物質設計!

electrode

13

graphene/Ni(111)のバンド構造

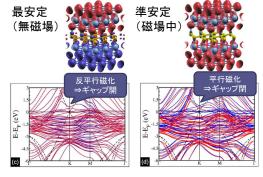
- 系はスピン偏極している。
- K点でπバンドはギャップを 持っている。
 - ← A-Bサイトのエネルギーにずれ(構造起源)がある。
- マジョリティ・スピンのπバンドはK点に小さい電子ポケットをもつが、同じ点においてマイノリティ側はギャップ中にフェルミ準位が来ている。



14

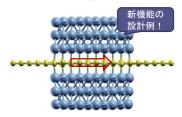
理想的なナノスピンバルブ

バルク構造とバンド構造



Y. Wicaksono, et al. CARBON 143 (2018) 828.

基礎となるNi/Gr/Niスピンバルブ状構造も作成可 Cf. S. Mandal, S.K. Saha, Nanoscale, 4 (2012) 986. 面内スピンバルブ構造

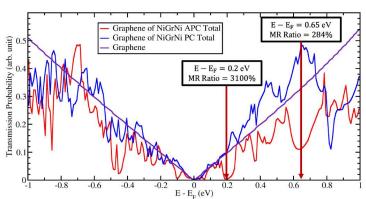


- カイラル対称性のスピン依存性
 - ・ 反平行⇒ギャップ形成
 - 平行⇒スピン偏極コーン がさらに、
- クーロン(スピン)ブロッケイド
- クライントンネリング と組み合わさって、理想的な スピンバルブ(面内にスピン 偏極電流が現れる)にできる。

16

16

Ni/グラフェン/Ni構造の透過確率



Y. Wicaksono, et al., RSC Adv., 12, 13985-13991 (2022).

- 横軸は、透過させる伝導電子のエネルギー。(ゲートコントロールを想定。)
- 反平行磁化配置(APC)で、透過確率が大きく落ち込むエネルギー域がある。
- 平衡磁化配置(PC)では、その領域でも高い透過確率を維持している。
- 結果、大きな磁気抵抗効果が見込まれ、MR Ratio > 3000 も生じうる。

17

ナノグラフェンとディラックゼロモード

グラファイト・GIC (4BC~、**1926**~) フラーレン (1970~、1985~) カーボン・ナノチューブ (1976~、1991~)

グラフェン・ナノグラフェン (1996~、2004~) 理論的指摘 実験的同定

ナノグラファイト(ナノグラフェン)の創始において、「フラーレン」、「カーボン・ナノチューブ」 (閉曲面上の量子効果)の物理と化学から生じた『発想の転換』があった。

これからはグラファイトの

「欠陥と端」(解放端境界条件での量子効果)

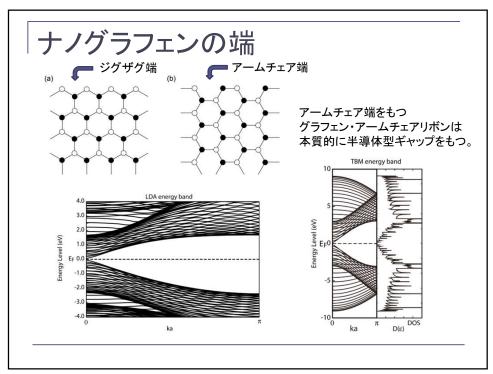
が重要になる。 藤田光孝氏による1996年当時の予言

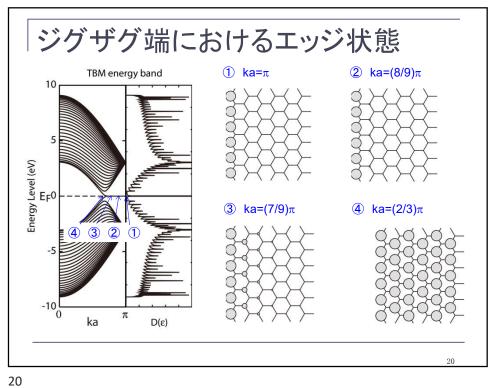
結果として、この予言は『有効ディラック演算子のゼロモード』が与える

「トポロジカル量子効果」

の物質中での発見と制御、活用、応用、の一例であることが後に分かった。

18

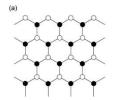


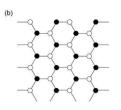


グラフェン・ゼロモードの物理

強結合模型によるグラフェンの電子状態 2副格子構造上の電子模型

$$H_{TBM}\left(\mathbf{k}\right) = \begin{pmatrix} 0 & H_{AB}\left(\mathbf{k}\right) \\ H_{BA}\left(\mathbf{k}\right) & 0 \end{pmatrix}.$$

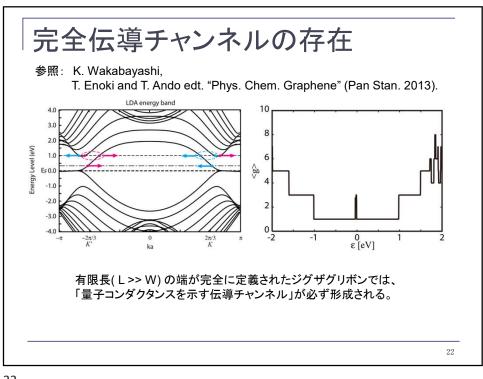


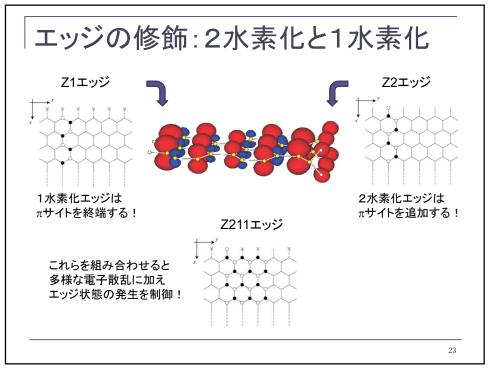


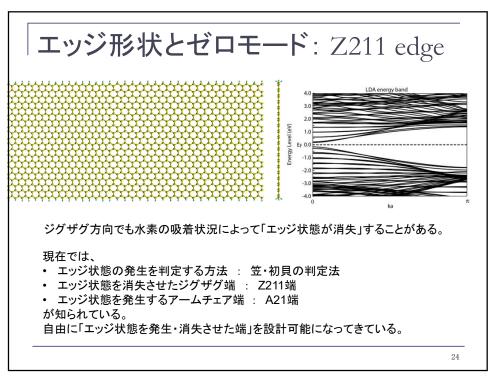
ゼロエネルギーのモードがカーネル状態である理由

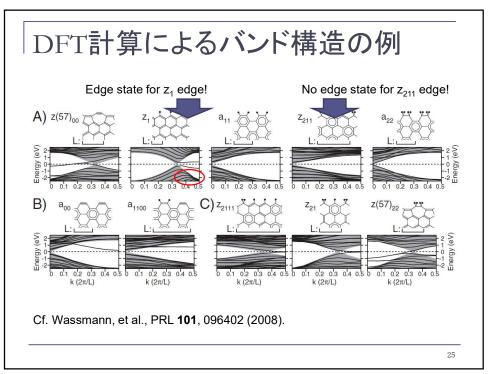
$$H_{TBM} = \begin{pmatrix} 0 & H_{AB} \\ H_{BA} & 0 \end{pmatrix}. \qquad H_{AB} \varphi_B = 0 \implies \psi_{zero} = \begin{pmatrix} 0 \\ \varphi_B \end{pmatrix}$$

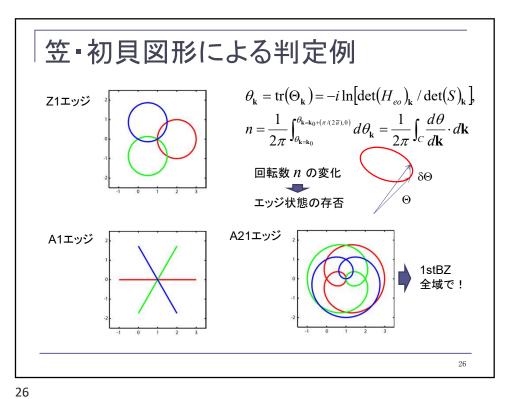
$$H_{TBM} \psi_{zero} = \begin{pmatrix} 0 & H_{AB} \\ H_{BA} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \varphi_B \end{pmatrix} = 0 \cdot \psi_{zero}$$

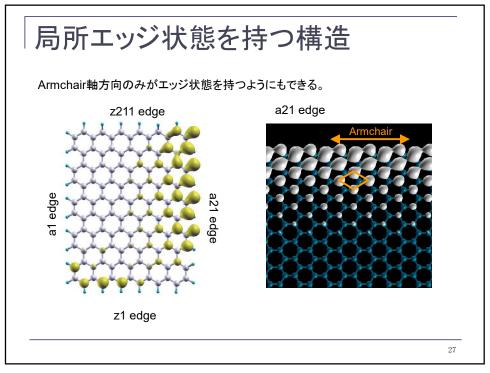






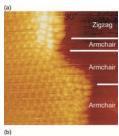




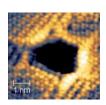


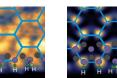
実験同定されたエッジ状態の有無

Kobayashi et al. (2005)



Ziatdinov et al. (2011)



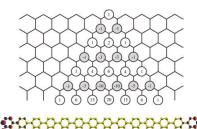


STM data

DFT simulations

28

局在性ゼロモードと強相関効果



強磁性(フェリ磁性)が確定とされた例

 $S = |N_A - N_B|/2!$

表面モードに関連する 「縮退ゼロモード(平坦バンド)」 の発生



局在型・非結合性ゼロモード

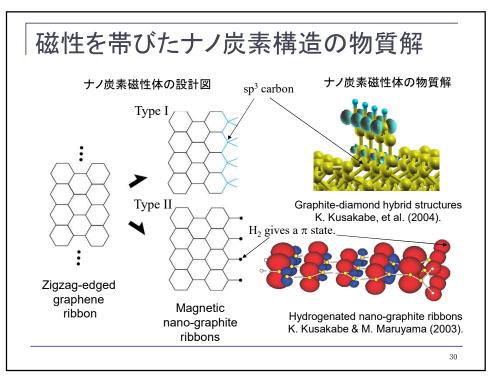


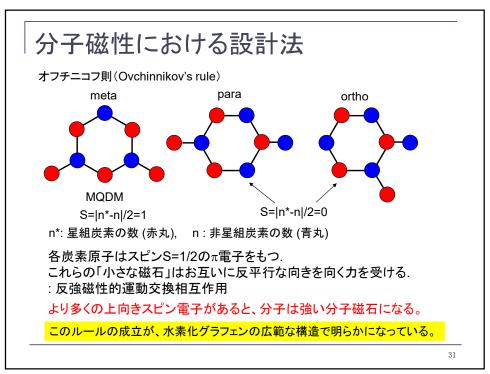
縮退固有モード: 一体項対角型 二体項(電子・電子間散乱)が支配的

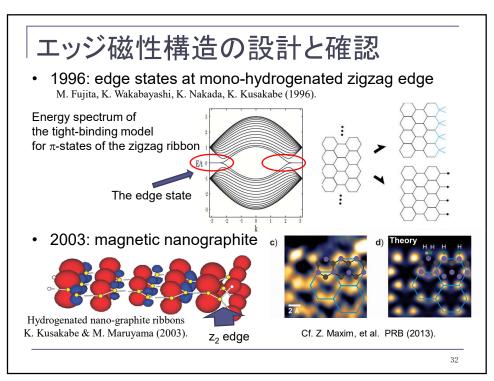


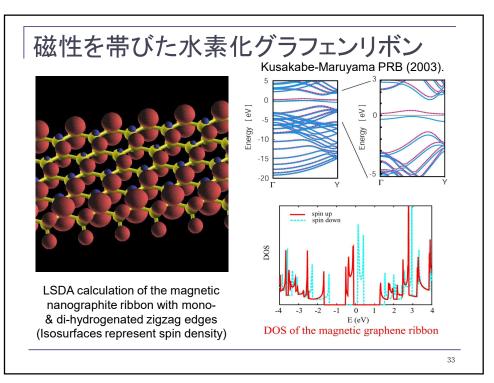
強相関電子系

- 強い量子効果と磁性 (強磁性・反強磁性・近藤効果)
- 強い量子効果と超伝導 (高温超伝導の可能性あり)







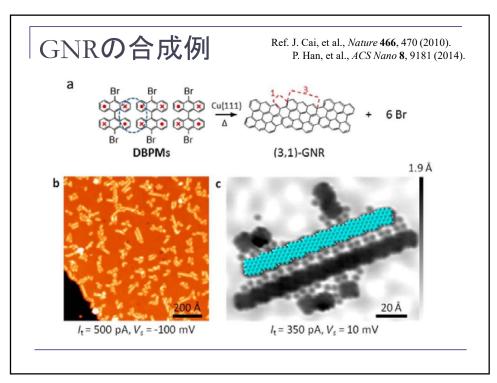


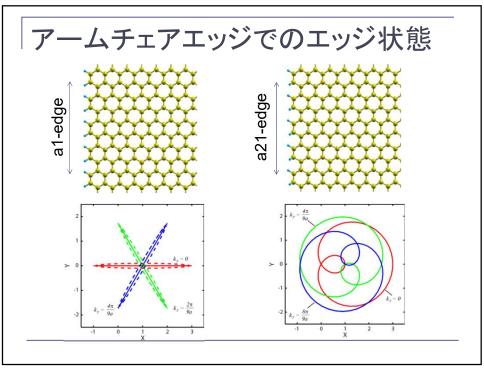
グラフェン・リボンの合成方法

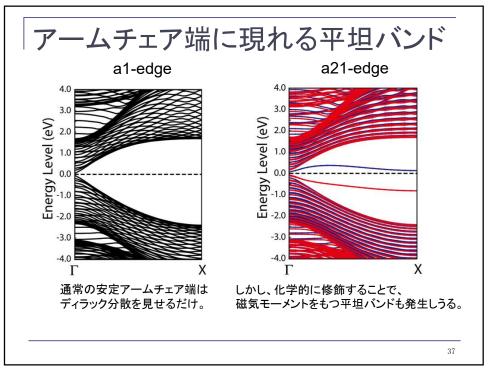
参照: T. Enoki and T. Ando edt. "Physics and Chemistry of Graphene" (Pan Stanford 2013).

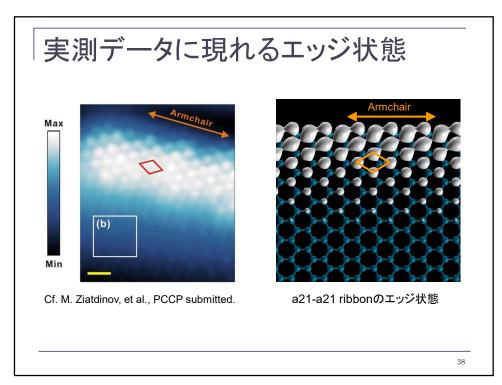
- 化学蒸着法
- 酸化グラフェン
- 炭素ナノチューブのアンジッピング
- 熱誘起構造変化
- ・電子ビーム露光、STM/AFM露光
- 結晶選択性化学反応
- 芳香族分子からのボトムアップ合成

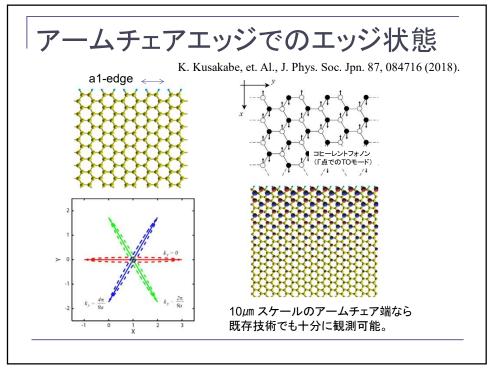
34











ナノ炭素材料を生かす

「理論設計法が強力に使えるナノ炭素材料」に適したデバイス設計法を考察する。

幾何構造による材料分類

- 基本となる対称性
 - グラフェン・蜂の巣格子
- 原子スケール構造
 - 原子欠陥
 - フラーレン類
 - チューブ、ホーン
 - 端(ジグザグ、アームチェア)
 - 官能基
- ナノスケール構造
 - グラフェン積層構造
 - チューブ・バンドル
 - ナノポア

極限環境を模倣した計算法

- 超高真空
 - スーパーセル法
- 媒質・媒体中(溶液、反応媒体)
 - スーパーセル法
- 圧力下、応力下(垂直、剪断)
 - 応力一定MD
- 強電場・強磁場
- 粒子線照射下
 - 時間依存計算、MD

40

40

Liイオン・キャパシタの特徴

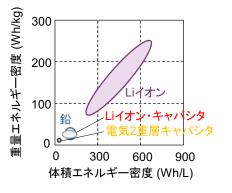
体積エネルギー密度

■ Wh/L: 1L (リットル)のエネルギー量

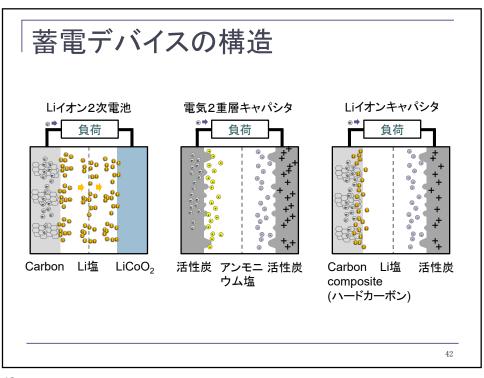
(B) 400 100 100 200 サインド 100 ニカド ニッケル水素 0 300 600 900 体積エネルギー密度 (Wh/L)

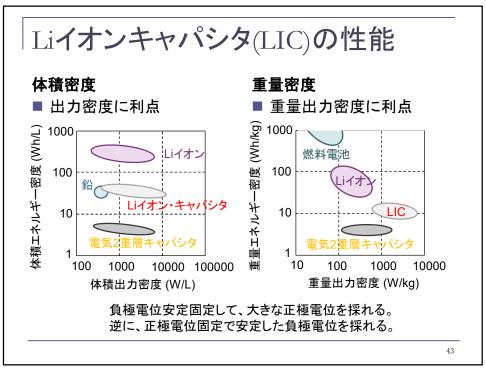
重量エネルギー密度

■ Wh/kg:1kgのエネルギー量



41





充電できる!

• ロードを接続した瞬間に動作できるとは、「充電状態」が与えられることを意味する。

ここに現実の観測結果を加えてみよう!

- LICは「過放電状態」にしてはならない。
 - ____ するとさらに戻って、
- LIC負極はLiプレドーピングにより作成される。
 - さらに推論して、
- LICでは、Liの運動を電極近傍の限られた空間にのみ生じるようにして、充放電繰り返しが安定に発生できている。

動作しているときの充電状態とは、ナノスケール以下のLiの移動で「セット」されるものである、ということが否定されてはまだいない。

ナノスケールでのLiの炭素近傍での運動を理解しておいてから 『設計』し直しても良い。

44

44

負極素材としての SWNT

- Liを多く吸蔵できる負極素材が必要である。 Li吸蔵量=充電容量 グラファイトのLi吸蔵量 Li:C=1:6
- SWNTは実験により、高いLi吸蔵量を示している。

末端にキャップ付き Li:C=1:6 末端にキャップ無し Li:C=2:6 [Ref.1]

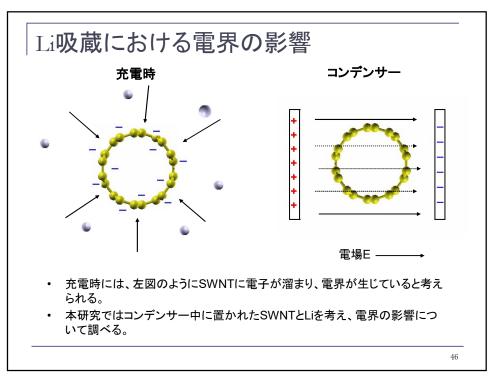
粉砕後 Li:C=2.7:6 [Ref.2]

[Ref.1]H.Shimoda,B.Gao,O.Zhou, et al, Phys.B 323,133-134(2002) [Ref.2]B.Gao,A.Kleinhammers,et al ,Chem.Phys.Lett 307,153-157(1999)

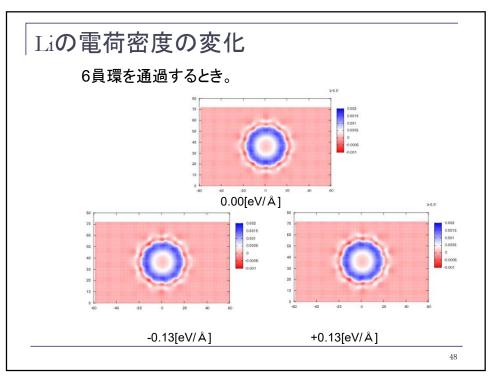
■ 理論計算によるLiイオン吸蔵のシミュレーションも実施されている。[Ref. 3,4]

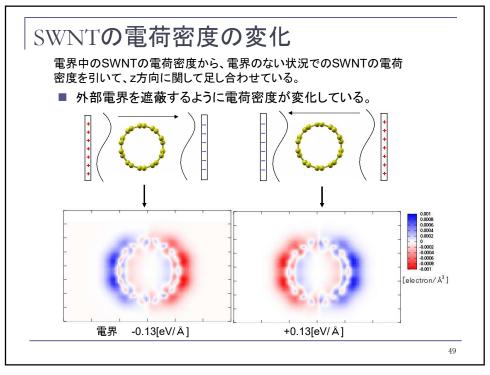
[Ref.3]V.Meunier, J.Kephart, C.Roland, J.Bernholc Phys.Lett 88 075506 (2002) [Ref.4] K.nishidate, M.Hasegawa Phys.B 71 245418 (2005)

45



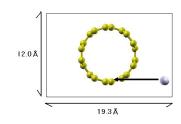
電界をかけた(5,5)SWNTのLi吸蔵について調べる。 第一原理計算プログラム TAPP+effective screening medium method(ESM) Ultra-soft pseudo potential Cut off enegy 340[eV] K points 1×1×5 Li,1 C,60 /Unit cell

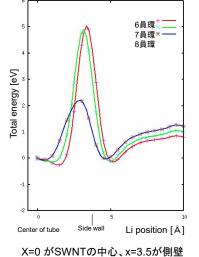




欠陥によるエネルギー障壁の変化

- Liの位置に対し、炭素原子を固定して計 算を行った。
- 欠陥を通ることによってエネルギー障壁 が低下する。
- 8員環欠陥では半分以下に低下する。





50

メタダイナミクス

反応座標系

$$\mathbf{s} = (s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6, \dots) \equiv (x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, \dots)$$

$$\mathbf{g}^{t} = -\frac{\partial E_0(\mathbf{s}^{t})}{\partial s_0(\mathbf{s}^{t})} \cdot \text{Interstomic force}$$

$$\mathbf{F}_{0i}^{t} = -\frac{\partial E_{0}(\mathbf{s}^{t})}{\partial \mathbf{s}_{i}^{t}}$$
: Interatomic force

t: メタステップ数

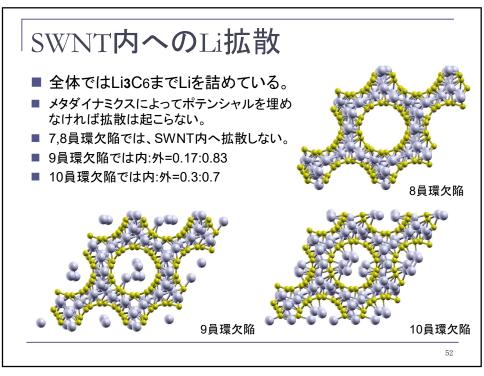


$$E_{g}(\mathbf{s}^{t}) = \sum_{t \leq t} \prod_{i} W \exp \left[-\left| \mathbf{s}_{i}^{t} - \mathbf{s}_{i}^{t'} \right|^{2} / 2\delta s^{2} \right]$$
 W: ガウス型ポテンシャルの重み δs : ステップパラメタ

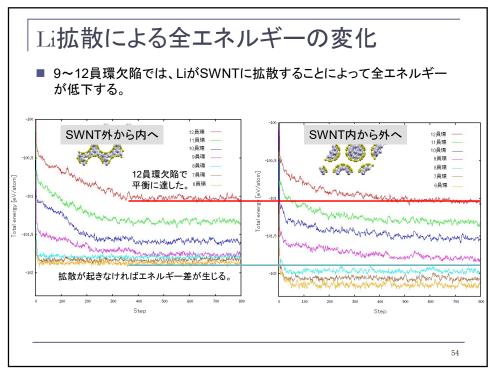
 $\mathbf{F}_{g_i}^t = -\frac{\partial E_g(\mathbf{s}^t)}{\partial \mathbf{s}_i^t}$: Gaussian driving force

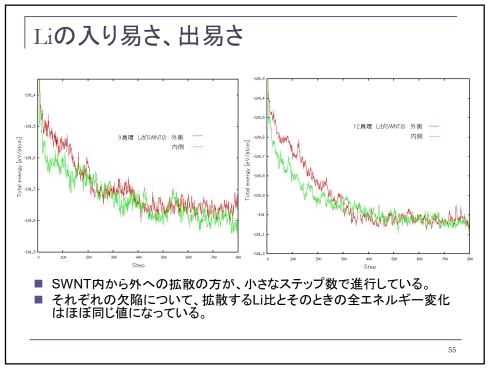
 $\mathbf{F}^{t} = \mathbf{F}_{0}^{t} + \mathbf{F}_{g}^{t}$: Total driving force

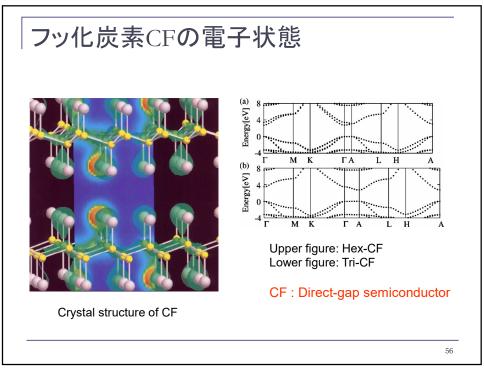
$$\mathbf{s}$$
のアップデート $\mathbf{s}^{t+1} = \mathbf{s}^t + \delta \mathbf{s} \mathbf{F}^t / |\mathbf{F}^t|$

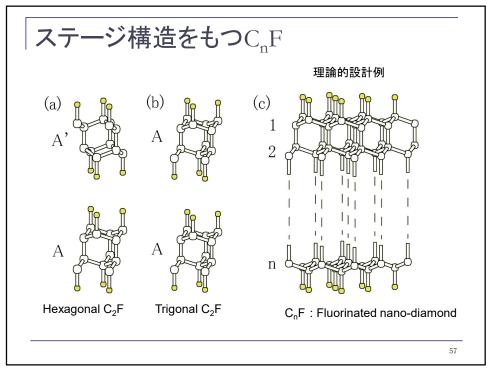


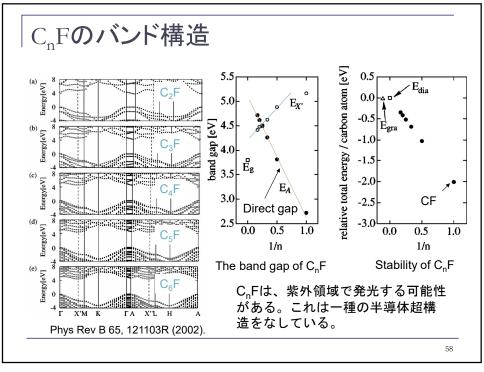
SWNT内へのLi拡散 ■ 11,12員環欠陥共にLiの比は内:外=0.5:0.5 ■ Lilは自由散乱しながら出入りを繰り返す。 11員環欠陥 12員環欠陥











超薄膜C_nFへのドーピング方法

- Post-synthesis doping
 - Ion implantation
 - Chemical doping in C_nF stage structure
 - Field effect
- Pre-synthesis doping
 - Boron doping in graphite
 - \blacksquare Co-doping (B_xN_y & H) in graphite

高純度CnFの合成には、

High-pressure, high-temperature synthesis

59

ワイドギャップ半導体の電子親和力

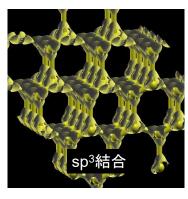
- 充分大きな表面から、その表面の特徴的な長さ程度の 距離を離れた場所を無限遠として、その位置での電子 に対するポテンシャルエネルギーを $\phi(\infty)=0$ とする。こ のときの仕事関数をフェルミエネルギー E_F と同一視す るとして定義すると、 E_F は表面の詳細に依存する。
 - 面方位
 - 表面構造
- 定性的・定量的評価は第一原理電子状態計算によって 可能であると考えられている。
- 特に、ワイドギャップ半導体では、負性電子親和力 (Negative Electron Affinity: NEA) が現れうる。

60

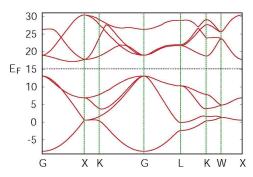
60

立方晶ダイヤモンド

電子密度の空間分布

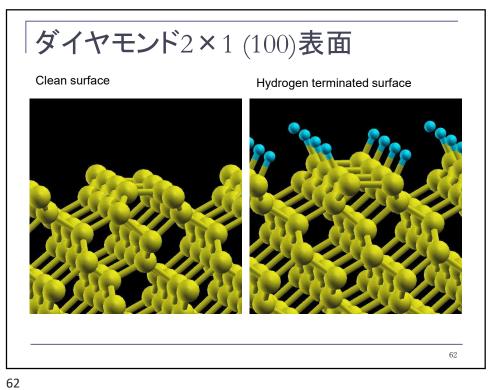


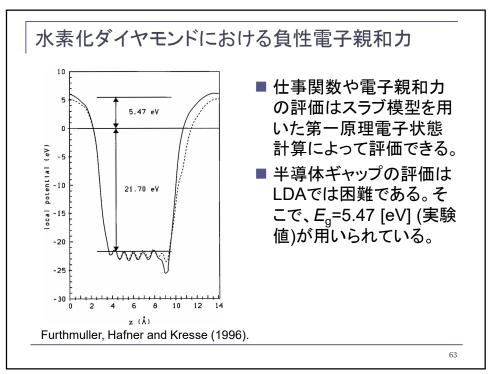
立方晶ダイヤのLDAによるバンド計算例

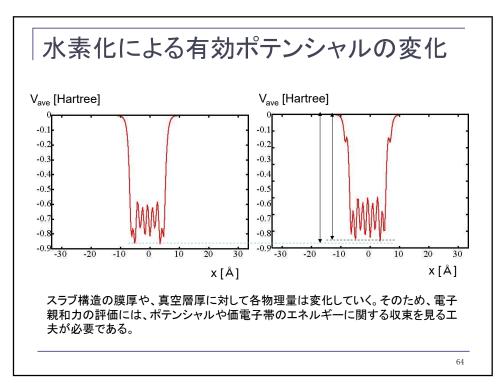


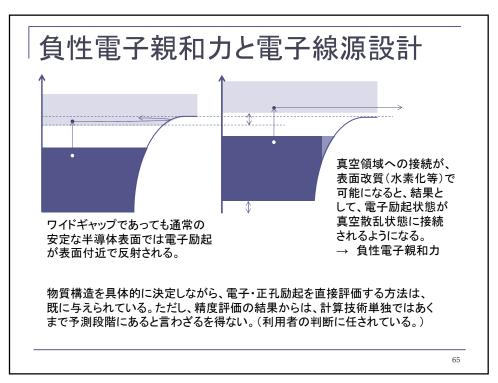
系はワイドギャップ半導体 Kohn-Sham-LDA ではJanakの議論により orbital energy からギャップ評価を行う。 が、MR-DFTでは素励起評価を行って良い。

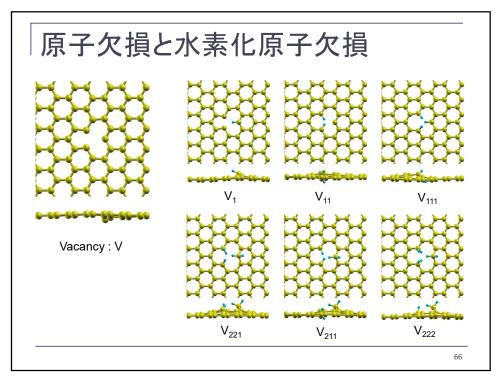
61

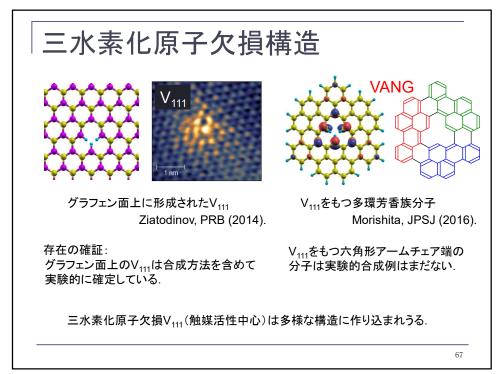


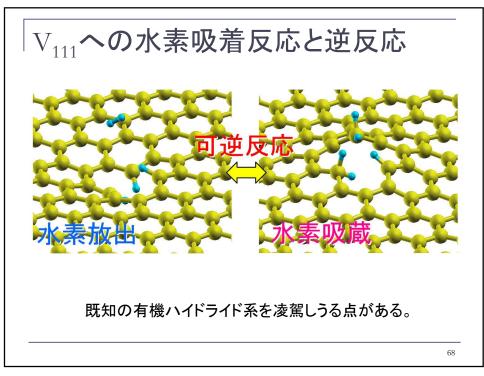






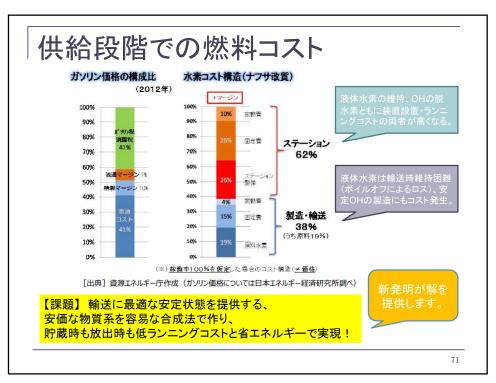






市場規模推測 我が国における水素・燃料電池関連の市場規模予測 ■定置用燃料電池 ■燃料電池自動車 ■水素発電 兆円/年 ■水素供給インフラ ■水素 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 [出典] 日本エネルギー経済研究所 我が国はこの分野の研究・開発と実用化において、世界的に先導してきている。 諸外国、特に米国・欧州における燃料電池車戦略の進展も著しくなってきている。





有機ハイドライド (OH): その限界



標準的液化水素を供 給源とした水素ステー ションは、現在なお数 億円規模の投資を必 要とする。

代替候補のOHでは、



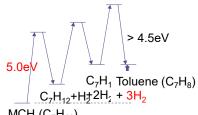
脱水素化 (酸化脱水素)



OH は触媒の利用と 高温・高圧での動作 が必須のプラントを 消費地に必要とする。 MCHからの脱水素過程の課題

- 吸熱反応:エネルギー供給が必用,
 - 高活性障壁:金属触媒等が必須.

熱分解時の吸熱量: 2.14 eV (obs.) (2.68 eV (in calc.))



MCH (C_7H_{14})

すると、液化水素代替においては必ずしも最適解とはなっていない。そこで、

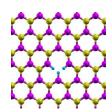
非吸熱、または発熱反応で脱水素過程が発生する「安全・経済 的水素媒体」が必用。

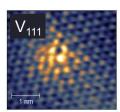
72

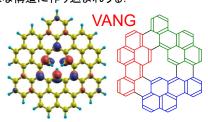
72

物質構造に関する補足

三水素化原子欠損V111(触媒活性中心)は多様な構造に作り込まれうる.







グラフェン面上に形成されたV111 Ziatodinov, PRB (2014).

存在の確証:

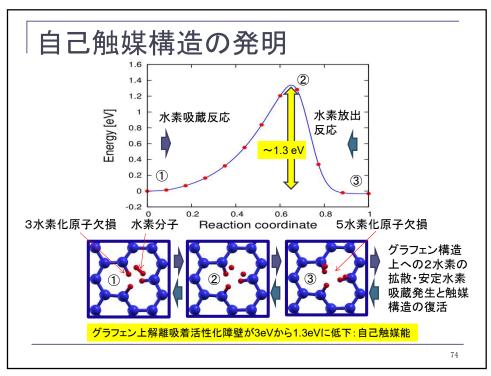
グラフェン面上のV111は合成方法を含めて 実験的に確定している.

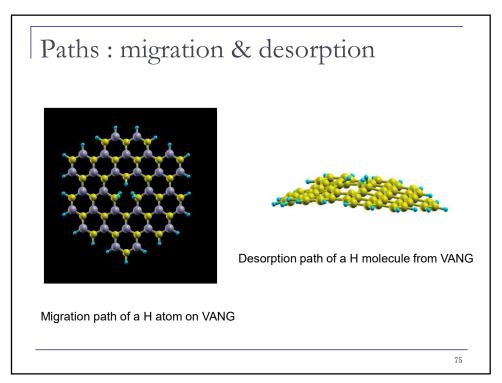
V111をもつ多環式芳香族分子 Morishita, JPSJ (2016).

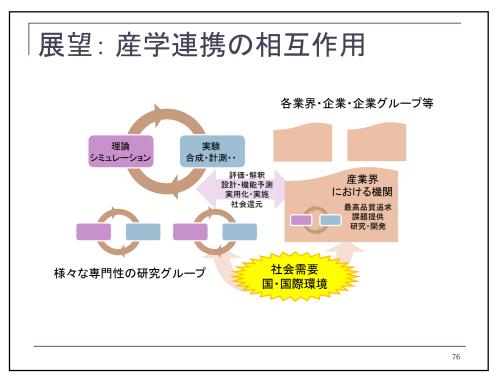
V₁₁₁をもつ六角形アームチェア端の 分子は実験的合成例がない. (有機合成すればさらに新規知財 の発生が見込まれる.)

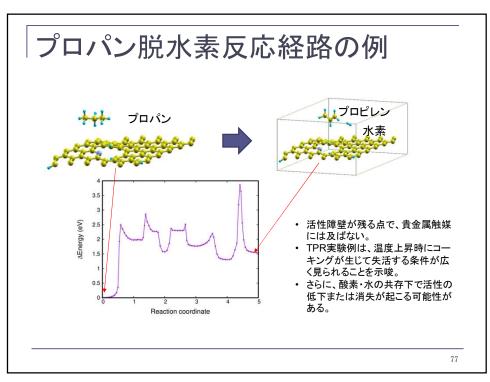
新規発明の一つは「V₁₁₁構造の触媒機能の利用」に関する.(赤矢印部分) V₁₁₁構造上の反応活性化 ⇒ 炭素材料·有機分子利用水素貯蔵デバイス

73









連携から見込まれる展開

- 水素化原子欠損の構成により水素の吸収・放出が容易化。
- オクタン、ヘプタンの脱水素反応を賦活化で活性化しうる。
- プロパン、ブタン等、短いアルカン分解には高温が必要。
- 大量合成法を必要とする。
- これらの当初見通しを超えるために、
- ・ 賦活化法(スパッタリング法他)の多様化
- 弾性反跳粒子検出法(ERDA)、ラザフォード後方散乱分析 (RBS)、昇温還元法(TPR)、質量分析(MS)、等

を組み合わせて水素関連技術への貢献を展開していく。

78

78

アルカン脱水素触媒としての展望



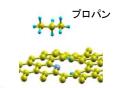
ナノダイヤモンド構造 Liu et al (2017)



カーボンナノチューブ構造 Liu et al (2017)



-ブ構造 金属+グラフェン構造 7) Zhang et al (2019)



窒素置換水素化原子欠損構造 Nishikawa, Riu, Kusakabe, Takai (2021)

酸素と金属を必要としない!

産学連携による成果

【名称】アルカン脱水素触媒、及びこれを用いる水素製造方法 【発明者】西川正浩、劉明、草部浩一、高井和之 【出願番号】2021534080 【請求項1】下記グラフェンを含むアルカン脱水素触媒。 1水素化原子欠損構造、2水素化原子欠損構造、 3水素化原子欠損構造、及び 窒素置換原子欠損構造から選択される少なくとも1種の構造 を有するグラフェンであって、前記構造を、 グラフェンの原子膜 100 nm²あたり2~200個有する。

高機能化を目指して努力してまいります。

ご静聴有難うございます。

79